赤外線法による内部欠陥測定に関する研究*1

Study on Measurement of Internal Defects by Infrared Thermography

臂 安彦 Y. HIJI 貴治雅博 M. KIJI 山田和明 K. YAMADA 楼 黎明 L. LOU

Authors have developed a nondestructive measurement method for internal defects using an optical excited thermography. In order to find optimal measurement conditions, experiments have been carried out under different light irradiation cycles and times. Furthermore, authors have proposed a method for quantitatively estimating the size of internal defects by differential processing of the phase difference distribution of surface temperature change. From the experimental results, it has been found that there exists an optimal irradiation cycles and times, and that these depend on tested material. Also, it has been recognized that internal defect size can be quantitatively estimated from differential processing of the phase difference distribution of surface temperature change, that estimation accuracy is related to the thermal conductivity of materials and materials with lower thermal conductivity show higher estimation accuracy.

Key Words: internal defect, nondestructive test, infrared ray, optical excited thermography

1. はじめに

従来,内部欠陥の非破壊測定法として超音波探傷法, 磁粉探傷法などがよく用いられているが,広範囲の測定 には多大の労力と時間を要することから,近年,非接触・ 短時間で広範囲の測定が可能な光励起サーモグラフィ法 が注目されている.光励起サーモグラフィ法の内部欠陥 測定に関する研究には、測定条件による内部欠陥の深さ 方向の検出能力を検討したものや内部欠陥の検出可否の みを簡単に検討したものが多く、内部欠陥の位置や寸法 の定量的な推定手法に関する報告は少なかった¹⁾.

本報では、光励起サーモグラフィ法を用いて、複数の 光照射周期や光照射時間の下で試験片の内部欠陥を測定 し、最適な測定条件において得られた試験片表面温度変 化の位相差分布を用いて、試験片内部欠陥幅の定量的な 推定を試みたので報告する.

2. 実験方法

図1に測定システムの概略図を示す.実験に使用した 赤外線サーモグラフィは Cedip Silver 480M である. 実験は、試験片表面を外部光源(ハロゲンランプ)によ り周期的に加熱し、赤外線サーモグラフィで温度映像を 撮影することにより行った.このとき、外部光源の制御 用信号(矩形波)を参照信号として、温度映像と同時に 記録する.試験片の表面温度は外部光源と同周期で変動 するが、試験片に内部欠陥が存在すれば、表面温度変化 の位相が変化する.試験片表面の各位置での温度変化デ ータに参照信号と同周期の正弦波を残差の和が最も小さ くなるように一致させ、参照信号と同期した正弦波との 位相差を比較することで温度変化の位相差分布を算出し た.また、同時に試験片表面各位置の温度変化データに 一致させた正弦波の振幅から温度変化量分布を算出し、 温度変化の位相差分布と比較した.



図1 測定システム概略図 Schematic of measurement system

基盤技術

 ^{* 1} 本論文は、2010年度日本非破壊検査協会 秋季大会講演概 要集(520106)を基に作成した。

試験片の内部欠陥は、下部材表面に幅の異なる3種類 のテフロンテープを介在させた状態で上部材を接着する ことで作製した.また、上部材には、熱伝導率の異なる Nd₂Fe₁₄B および S15C を用いた.**表1**,2に測定条件と 試験片の仕様をそれぞれ示す.図2に試験片の内部欠陥 の様子を示す.実験では、試験片に放射率0.94の黒体 塗料をスプレーし、光照射周期を3~40秒までの1秒 ごと、光照射時間を1、3、5秒、積算周期を10周期分、 赤外線サーモグラフィのフレームレートを300Hz とし て、それぞれの条件で内部欠陥を測定した.

表1 測定条件 Measurement conditions

| 赤外線サーモグラフィ | Cedip Silver 480M |
|------------|-------------------|
| 外部光源 | ハロゲンランプ 500W×2 |
| 光源制御方法 | ON · OFF 制御 |
| 光照射周期 | 3~40s (1sごと) |
| 光照射時間 | 1, 3, 5s |
| 積算周期数 | 10 周期 |
| フレームレート | 300Hz |

表2 試験片の仕様 Specification of test piece

| 上部材材質 | $Nd_2Fe_{14}B$, $S15C$ |
|---------|-----------------------------------|
| 上部材寸法 | $8 \times 64 \times 2$ mm |
| 上部材熱伝導率 | $Nd_2Fe_{14}B = 7W/(m \cdot K)$, |
| | $S15C = 52W/(m \cdot K)$ |
| 内部欠陥幅 | 20, 10, 5mm |
| 備考 | 放射率 0.94 の黒体をスプレー塗布 |



図2 試験片の内部欠陥 Internal defects of test piece

3. 実験結果および考察

Nd₂Fe₁₄B 製試験片, S15C 製試験片それぞれの場合 について、図3,4に温度変化量分布を、図5,6に温度 変化の位相差分布を、図7,8に試験片中央長手方向の 温度変化の位相差分布を示す.図3~8は内部欠陥にお ける位相差変化が最も強調された測定条件におけるもの であり、Nd₂Fe₁₄B 製試験片では、光照射周期 15 秒、 光照射時間5秒,S15C製試験片では,光照射時間12秒, 光照射時間5秒の条件であった。図3.4に示す温度変 化量分布では内部欠陥を検出できないが、図5.6に示 す温度変化の位相差分布では内部欠陥が検出できること が分かる.Nd₂Fe₁₄B 製試験片とS15C 製試験片の温度 変化の位相差分布を比較すると、Nd₂Fe₁₄B 製試験片の 方が、内部欠陥部における位相変化が大きい. これは Nd₂Fe₁₄B 製試験片の熱伝導率が S15C 製試験片よりも 小さいため、内部欠陥で遮断された熱の拡散が小さくな り、内部欠陥部における位相変化が強調されたと考えら れる.また、図7,8より内部欠陥幅と位相差分布の山 の幅には相関があるものの、熱拡散の影響で実際の内部 欠陥幅より位相分布幅が大きくなっていることが分かっ た. さらに, 温度変化の位相差分布から内部欠陥幅を推 定したが、内部欠陥部と内部欠陥なし部の境界付近の位 相差分布には熱拡散の影響と考えられる勾配があるた め、内部欠陥幅の定量的推定は困難であった. この傾向 は試験片の材質にかかわらず、すべての測定条件におい ても同様であった.



図3 温度変化量分布(Nd2Fe14B) Distribution of temperature variation(Nd2Fe14B)



図4 温度変化量分布(S15C) Distribution of temperature variation (S15C)



温度変化の位相差分布(Nd₂Fe₁₄B) 図5 Phase difference distribution of temperature variation $(Nd_2Fe_{14}B)$



図6 温度変化の位相差分布(S15C) Phase difference distribution of temperature variation (S15C)



図7 温度変化の位相差分布 (Nd₂Fe₁₄B) Phase difference distribution of temperature variation (Nd₂Fe₁₄B)



図8 温度変化の位相差分布(S15C) Phase difference distribution of temperature variation (S15C)

4. 微分処理による内部欠陥幅の推定

位相差分布から内部欠陥幅を推定するため、次のデー タ処理を試みた.まず,各内部欠陥幅の位相差分布(図7) から、内部欠陥なしの位相差分布をそれぞれ差し引き、 内部欠陥以外の要因で発生する位相差変化を取り除いた (図9). さらに、位相差分布の隣接する2点に対し、微 分処理を施し、微分値が極値をとる位置の距離を内部欠 陥幅と推定した(図10). 図11にNd₂Fe₁₄Bおよび S15C 製試験片において、内部欠陥幅の推定値と実際の 幅を比較した結果を示す. 図11より, Nd₂Fe₁₄Bおよ び S15C 製試験片の両者において、内部欠陥幅の推定値 は実際の幅に近いことが分かる. さらに, S15Cより Nd₂Fe₁₄B 製試験片の方が、実際の幅に近い値を示し、 内部欠陥幅が小さいときは両者の差がより顕著になるこ とが分かる. これは, 熱伝導率の小さい Nd₂Fe₁₄B の方 が、内部欠陥で遮断された熱の拡散が少ないことに起因 するものと考えられる.

基盤技術



図9 位相差分布 データ処理後 (Nd₂Fe₁₄B) Phase difference distribution after data processing (Nd₂Fe₁₄B)







5. おわりに

光励起サーモグラフィ法を用いて,複数の光照射周期 と光照射時間の下で,試験片の内部欠陥を測定した.そ の結果,試験片表面の温度変化量の分布ではなく,温度 変化の位相差分布により,内部欠陥の測定が可能である こと,試験片表面温度変化の位相差が最も大きくなる最 適な光照射周期および光照射時間が存在し,それは試験 片の材質により異なることが分かった.また,温度変化 の位相差分布に微分処理を施すことにより,試験片の内 部欠陥寸法の定量的推定が可能であり,熱伝導率の低い 材料の方がより高精度に内部欠陥寸法を定量的に推定で きることが分かった.

参考文献

 寺田博之,阪上隆英:赤外線サーモグラフィによる設備 診断・非破壊評価ハンドブック、社団法人日本非破壊検 査協会(2007).

筆者







拿安彦^{*} Y. HIJI

貴治雅博^{*} M. KIJI

山田和明^{*} K. YAMADA



俊 黎明 L. LOU

研究開発本部 研究開発センター FP 研究部